

株式会社テクノミュー

TFL2100
回転型
シリーズ

非接触平面度平行度測定機

new



特長

- ・ 低価格にて高精度な測定を実現
- ・ データ収集が高速
- ・ 非接触なので検査対象を傷つける心配がありません
- ・ 測定対象物による影響が非常に少ない
- ・ 重量物の測定が可能
- ・ 高精度の面振れを実現
- ・ ご使用の対象物形状に合わせてシステム構築が可能（ご相談下さい）

低価格

高精度な面ぶれ精度の
搭載テーブル

平面度と平行度を同時に
測定できます

用途

- ・ 円盤状の金属、あるいは樹脂、セラミックなどの平面度、平行度の測定
- ・ ディスクタイプのものであれば、どのようなものでも測定可能です

仕様

項目		仕様
基準距離		80mm
Z軸方向測定範囲		±18mm
測定方式		三角測距式
光源	レーザ	半導体レーザ
	波長	655nm 可視光CLAS3R
	出力	4.8mW
繰り返し測定精度		0.1 μm (注1)
センサ部移動量	Z軸ステージ(手動、固定式)	±20mm, ±50mm
X軸部	移動量	120mm(MAX)
	最小送り量	2 μm/STEP
	最高移動速度	50mm/SEC
	位置決め精度	20 μm以内
	繰り返し位置決め精度	±5 μm以内
	バックラッシュ・ロストモーション	10 μm以内
θ軸部	回転量	360°
	最小送り量	0.6° /Pulse
	最高回転速度	10rpm (測定速度)
	テーブル面	φ130 (ワークφ320迄搭載可能)
	耐荷重	20Kg
	位置決め精度	10 μm以内
繰り返し振れ精度		5 μm以下
測定台	外形・重量	約 W540×H480×D280 約25Kg
制御部	パソコン	PC/AT互換機
	ステージドライバ	5相マイクロステップドライバ
	USBI/F	USB2.0
	外形・重量	約 W350×H180×D255 7Kg以下
データ処理	測定データ量	600データ/回転
PCソフトウェア	平面度測定専用プログラム	OS Windows2000,XP,7対応

(注1)レーザセンサの単体精度です。またレーザセンサは変更することが可能です。(但しステージ部に搭載可能であること)

仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

この仕様以外に、測定したいワークの形状や、小さいものから大きいものまで対応可能ですのでご相談ください。

非接触測定機の専門メーカー



株式会社テクノミュー

〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢2-54-17

計測システム部 TEL: 04-2945-1483 FAX: 04-2945-9541

E-mail: tm_info@technomu.co.jp URL: <http://www.technomu.co.jp>